

分析機器部門講習会シリーズ

超解像共焦点レーザー顕微鏡 TCS SP8 STED(Leica Microsystems)デモンストレーション

Gated Detection 技術を搭載した Gated STED 顕微鏡は最高分解の 50nm の超解像レーザー顕微鏡のデモンストレーションを以下の日程で行います。

日時 : 平成25年7月24日(水) 10:00～7月26日(金) 14:00

使用機器 : TCS SP8 STED (Leica Microsystems)
倒立顕微鏡 DMI6000B
ホワイトライトレーザー (470nm～670nm 可変) 搭載

場所 : ~~旧西病棟6階 超微形態研究室4~~
医系研究棟2号館1階 共通ゼミ室 (場所を変更しました)

申込期間 : 平成25年7月23日(火) まで

申込方法 : サンプルのある方は電子メールで、「GSTED」、「所属講座」、「氏名」、「内線番号」、「電子メールアドレス」を明記の上、
ikuyo@med.nagoya-u.ac.jp 宛にお申し込みください。

機器の見学のみの方は、メールにその旨をお書きください。

お問い合わせ先

医学教育研究支援センター 分析機器部門

担当:水口 幾久代 (内線:2404、Email: ikuyo@med.nagoya-u.ac.jp)

※Web でも講習会情報を掲載しています (<http://www.med.nagoya-u.ac.jp/kiki/workshop/index.html>)

超解像 共焦点レーザー顕微鏡

デモンストレーションのお知らせ

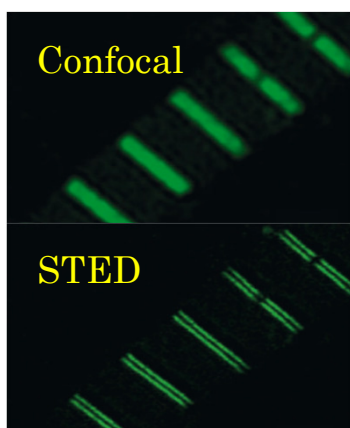
日時：7月24日（水）10時～26日（金）14時

場所：医系研究棟 2号館 1階 共通ゼミ室

NEW

今まで撮影することができなかった微細な構造が撮影できる超解像レーザー顕微鏡です。光学顕微鏡の対物レンズで励起光を集光することができるスポット径は最小で200nmです。これが光学顕微鏡の分解能の限界とされています。

最新のGated Detection技術を搭載したgSTEDシステムは最高分解能 50nm です。世界で唯一光学的に超解像を実現したGated STED顕微鏡をデモンストレーションいたします。是非この機会に超解像を体験ください。



超解像特徴

- 光学的に超解像画像を撮影できる
- 演算処理によるアーティファクトなし
- 3次元連続断層撮影が可能
- 一般的な蛍光タンパク・蛍光色素が利用可能。
- 超解像でライブセルイメージング



機器仕様
TCS SP8 STED
倒立型顕微鏡DMI6000B
レーザー405nm,
ホワイトライトレーザー470-670nm可変
高感度ディテクタHyD搭載

お申込み 見学、デモご希望の方は事前のお申し込みが必要です。

お問合せ先 ライカマイクロシステムズ株式会社 松田 090-4622-0662
koji.matsuda@leica-microsystems.co.jp

Leica
MICROSYSTEMS